

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成26年10月16日 (2014.10.16)

【公表番号】特表2013-545076(P2013-545076A)

【公表日】平成25年12月19日 (2013.12.19)

【年通号数】公開・登録公報2013-068

【出願番号】特願2013-531602(P2013-531602)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/27 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 N 21/27 F

G 0 1 N 21/27 B

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月1日 (2014.9.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

モニター装置とフィルターカートリッジの耐用期間とを相関付ける方法であって、  
前記モニター装置を提供する工程と、  
前記モニター装置を較正して、前記フィルターカートリッジの耐用期間に対応する工程  
とを含み、  
前記モニター装置が、  
容器内のデマンド物質、  
検出点を有する検出要素、  
前記検出要素用のリーダー、及び  
流体送達パラメーターを含む流体送達装置、を含み、  
前記流体送達パラメーター及び前記検出要素の前記検出点が  
前記フィルターカートリッジの耐用期間に相関付けられた、方法。

【請求項 2】

前記モニター装置を較正して、前記フィルターカートリッジの耐用期間に対応する工程  
が  
前記フィルターカートリッジに対する滞留時間を決定する工程と、  
前記モニター装置に対する滞留時間を決定する工程と、  
前記モニター装置の滞留時間と、  
前記フィルターカートリッジの滞留時間との比を決定する工程と、  
前記比を使用して、  
前記モニター装置内の前記センサー内の応答を前記フィルターカートリッジの耐用期間  
に相関付ける工程とを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記モニター装置内の前記センサーの応答が、前記流体送達装置の前記流体送達パラメーターの制御により前記フィルターカートリッジの耐用期間に相関付けられ、前記流体送達パラメーターが、流量、デマンド物質重量、容器断面積、容器容積、容器長さ、及び前記モニター装置のデマンド物質充填密度を含む、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記フィルターカートリッジの耐用期間が、式：

$$t_{SL} = t_b (W_{\text{カートリッジ}} Q_{\text{モニター}} / W_{\text{モニター}} Q_{\text{カートリッジ}})$$

により記述され、式中、

$t_{SL}$  が前記フィルターカートリッジの耐用期間であり、

$t_b$  が前記モニターの耐用期間であり、

$W_{\text{カートリッジ}}$  が前記カートリッジ内の前記デマンド物質の重量であり、

$Q_{\text{モニター}}$  が前記モニター内の流量であり、

$W_{\text{モニター}}$  が前記モニター内の前記デマンド物質の重量であり、

$Q_{\text{カートリッジ}}$  が前記カートリッジ内の流量である、請求項 3 に記載の方法。